



本社

SÜSS MicroTec AG
Schleissheimer Str. 90
D-85748 Garching
ドイツ
電話番号: (+)49 - 89 32 00 70
ファックス番号: (+)49 - 89 32 00 71 62
E-Mail: info@suss.com
Web: www.suss.com

問い合わせ先

Mrs. Brigitte WEHRMANN
Marketing Communications Manager
電話番号: (+)49 - 89 32 00 72 37
ファックス番号: (+)49 - 89 32 00 71 62
E-Mail: brigitte.wehrmann@suss.com

日本法人

ズース マイクロテック株式会社
226-0006 神奈川県横浜市緑区白山 1-18-2
ジャーマン インダストリー&トレード センター
電話番号: (+)81 - 45 93 15 600
ファックス番号: (+)81 - 45 93 15 601
E-Mail: Info@suss.jp
Web: www.suss.jp

問い合わせ先

Ms. Mayumi MATSUKI
Marketing Communications Manager
電話番号: (+)81 - 45 93 15 600
ファックス番号: (+)81 - 45 93 15 601
E-Mail: m.matsuki@suss.jp

SÜSS MicroTec は、半導体製造装置業界のワールドリーダーとして、ナノテクノロジー、MEMS、アドバンストパッケージ、化合物半導体、SOI、3D インターコネクト等の市場に革新的なソリューションを提供しています。当社は、ナノインプリントシステム、フォトレジスト及び誘電体コーティング/焼成/開発システムなどの製造ライン一揃いを製造しております。

SÜSS MicroTec の装置は熱/UV 照射、シングルインプリントやステップ&リピート (SSIL=Step and Stamp Imprint Lithogray) など、最新の費用効果に優れた、マイクロ/ナノサイズのレプリカ製造技術をサポートいたします。

SÜSS MicroTec は、三つの技術を提供しております。UV ナノインプリント・リソグラフィ (UV-NIL)、サブストレート・コンフォーマル・インプリント・リソグラフィ (SCIL) およびマイクロレンズ・インプリント・リソグラフィ技術 (SMILE) です。

特に UV-NIL とその発展技術は、サブ 50nm 形状をプリントする高解像度 e ビーム・リソグラフィよりも高スループットを提供する、費用対効果の高いインプリント技術です。

SCIL は、大面積インプリント分野とサブ 50 nm クラスの高解像度パターンを鮮明にプリントする分野との溝を埋める新技術で、オランダのアイントホーフェンに本拠を置く Philips Research により開発され、技術ライセンス契約に基づき SÜSS MicroTec が技術譲渡を受けているものです。

SÜSS MicroTec の SMILE は、低コストの CMOS カメラを製造するために用いられる 8 インチレンズウェハを安価で製造できるコスト削減の高い製造技術です。SMILE は液状ポリマーをウェハ上に塗布し、透明なスタンプまたはモールドを通して UV 光を照射することでポリマーを硬化させレンズをインプリントする複製技術です。

さらに詳しい情報は、Johann Weixlberger (Business Development Manager Nanotechnology) johann.weixlberger@suss.com までお問合せ下さい。